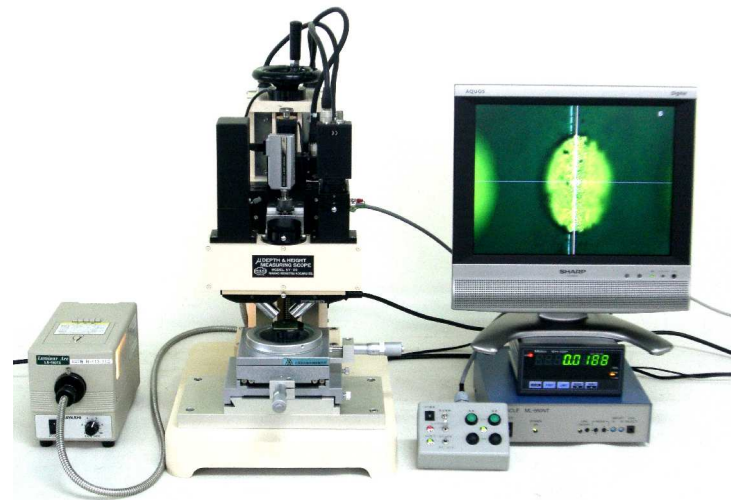


A F ・ ミクロン深さ高さ測定機



特 徴

- 1 . 光切断によるスリット像観察とスポット光像によるA F（オートフォーカス）追従を組み合わせた新しいタイプの深さ高さ測定機です。
- 2 . 連続追従A F 駆動で繰り返し精度の高い測定が操作性良くスピーディーにできます。
- 3 . スリット像が映し出す段差形状を観察しながら測定する方式なので、測定画面上の高低をリアルタイムでプロファイルが認識でき、測定が必要な高低箇所を実際に判断できます。
- 4 . 測定点でスリット像・スポット光像・電子ライン基準線の中心がすべて一致する測定システムで、そのズレのチェックにより誤った数値での測定を防止することができます。
- 5 . 光切断の仰角は標準の90°の他30°・60°・120°と用途に応じて選択導入できます。

主 な 仕 様

観 察 方 法	光切断方式（スリット光学系による深さ高さ測定）
対 物 レ ン ズ	固定倍率10倍（5倍、20倍もございます）
Z 軸 駆 動 方 式	スポット光によるA F 連続追従方式（オフラインで手動測定可能）
投射スリット	10 μ m ハーフミラータイプ
Z 軸 測 定	自動測定範囲10mm,自動移動量40mm,手動移動量200mm.
繰り返し精度	$\pm 1 \mu$ m以内、Z軸デジタルリニアゲージ0.1 μ m 読み
使用する光源	半導体レーザー（クラス2）、ハロゲン光源

用途に応じての仕様変更・カスタマイズが経済的にご利用頂けます
省力化、自動化用にオートフォーカス顕微鏡もご用意されて折ります。

開発製造・日商精密光学株式会社：連携会社

ショールーム：〒369-03 埼玉県児玉郡上里町七本木 2734-1



開発販売・株式会社オプレンス

〒336-0932 さいたま市緑区中尾 333-12

TEL: 048-875-9474 FAX: 048-873-9128

E-mail:k.kosaka@oprence.com 営業技術/小坂